





PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference NEC03P032 FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/4)			ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day)	/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/JP2003/007761	19 June 2003 (19.0	6.2003)	27 June 2002 (27.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or n H01L 29/78, 21/336	ational classification and IPC		
Applicant	NEC CORPORA	TION	
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant at	ination report has been prepare coording to Article 36.	ed by this Intern	national Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	10 sheets, include	ling this cover	sheet.
amended and are the basis for	nied by ANNEXES, i.e., sheets or this report and/or sheets cont e Administrative Instructions un	taining rectifica	on, claims and/or drawings which have been ations made before this Authority (see Rule
These annexes consist of a to	otal ofsheets.		
3. This report contains indications rela	ating to the following items:		
I Basis of the report			
II Priority			
III Non-establishment	of opinion with regard to nove	elty, inventive s	tep and industrial applicability
IV Lack of unity of in	vention		
V Reasoned statemen	nt under Article 35(2) with regardations supporting such statem	ard to novelty, i	nventive step or industrial applicability;
VI Certain documents			
·	the international application		
	ns on the international applicat	ion	
_			
Date of submission of the demand	Dat	e of completion	of this report
Date of submission of the demand	Dav		
19 June 2003 (19.06.	.2003)	22 D	December 2003 (22.12.2003)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Aut	Authorized officer	
Facsimile No.	Tel	ephone No.	



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

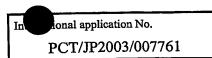
Internal application No.

PCT/JP2003/007761

 \hat{G}

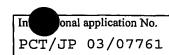
I. Basis of the report				
1. W	/ith r	egard to	the elements of the international application:*	
\triangleright	◁	the inter	national application as originally filed	
Ē	Ī	the desc	ription:	
-		pages	, as originally filed	
		pages	, filed with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
٢	٦	the clair		
_	_	pages	, as originally filed	
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19	
		pages	, nied with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
Γ		the drav	wings:	
_		pages	, as originally filed	
		pages	, filed with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
١	\neg_{t}	he seque	ence listing part of the description:	
ן '		pages	, as originally filed	
		pages	, filed with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
3.	the in Thes	the lar the lar the lar or 55	I to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international examination was carried out on the basis of the sequence listing:	
l	님		ned in the international application in written form.	
l	H		ogether with the international application in computer readable form.	
	H		hed subsequently to this Authority in written form. hed subsequently to this Authority in computer readable form.	
		The	statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the sational application as filed has been furnished.	
			statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has furnished.	
4.		The a	the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig	
5.		This r	report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go did the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	
	in t and	his repo ! 70.17).	t sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to ort as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 ,	
**	* Any	replace	ment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.	





W. V. L. Switz of invention
IV. Lack of unity of invention
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:
restricted the claims.
paid additional fees.
paid additional fees under protest.
neither restricted nor paid additional fees.
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is
complied with.
not complied with for the following reasons:
SEE SUPPLEMENTAL SHEET
, and the second
 Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:
all parts.
the parts relating to claims Nos

INTERNATIONAL PRED...INARY EXAMINATION REPORT



Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV. 3.

There must be a special technical feature so linking a group of inventions of claims as to form a single general inventive concept in order that the group of inventions may satisfy the requirement of unity of invention. The inventions of claims 1 to 20 are linked only by the technical feature that a "gate insulating film" comprises a "metal silicate film."

However, it is clear, as mentioned in the "background art" of the description of this application, that this technical feature is well-known and cannot be a special technical feature. Therefore there is no special technical feature so linking the group of inventions of claims 1 to 20 as to form a single general inventive concept.

Consequently, it is obvious that the inventions set forth in claims 1-20 do not comply with the requirement of unity of invention.

Next, the number of inventions of the claims in the international application so linked as to form a single general inventive concept, namely, the number of inventions, will be examined. Considering the specific modes of the inventions of the claims, the claims of the international application define six inventions: the invention of claims 1-5, 8, 11-13, 16-19, the invention of claim 6, the invention of claims 7, 15, the invention of claim 9, the invention of claims 10, 14 and the invention of claim 20. From among the inventions, the inventions of claims 1-5, 8, 11-13, 16-19 and of claim 6 are linked only by the technical feature wherein "a gate insulating film" has "a structure in which nitrogen is introduced into a metal silicate." However, this

INTERNATIONAL PREDMINARY EXAMINATION REPORT

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV. 3.

technical feature is also well-known and cannot be a special technical feature, as mentioned in the "background art" of the description. Similarly, the relationship among claims 1-5, 8, 11-13, 16-19 and claims 10, 14, and the relationship among claim 6 and claims 10, 14 involve no special technical features. The inventions of claims 1-5, 8, 11-13, 16-19, claims 7, 15, claim 9, and claim 20 are linked by the technical feature that "the position where the nitrogen concentration is highest in the direction of film thickness is a region away from the silicon substrate", with respect to the technical feature that "a gate insulating film" includes a nitrogen-containing high dielectric constant insulating film having "a structure in which nitrogen is introduced into a metal silicate".

Consequently the number of inventions in this international application is three: (1) the invention of claims 1-5, 8, 11-13, 16-19, claims 7-15, claim 9, and claim 20; (2) the invention of claim 6; and (3) the invention of claims 10, 14.

INTERNATIONAL PRESENTINARY EXAMINATION REPORT

ı	V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
1		citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	4, 9, 10, 14, 16-19	YES
		Claims	1-3, 5-8, 11-13, 15, 20	NO
ļ	Inventive step (IS)	Claims	16-19	YES
		Claims	1-15, 20	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

- Document 1: H.-J. Cho et al., Novel Nitrogen Profile

 Engineering for Improved TaN/HfO2/Si MOSFET

 Performance, International Electron Devices

 Meeting. Technical Digest 2001
- Document 2: Hag-Ju Cho et al., Structural and Electrical Properties of HfO₂ With Top Nitrogen Incorporated Layer, IEEE Electron Device Letters, Vol. 23, No. 5, May 2002
- Document 3: JP 2002-60944 A (International Business Machines Corporation), 28 February 2002
- Document 4: JP 10-242461 A (Sony Corporation), 11
 September 1998
- Document 5: JP 2002-164343 A (Agere Systems Guardian Corporation), 7 June 2002
- Document 6: US 6365467 B1 (Hyundai Electronics Industries Co., Ltd.), 2 April 2002

Claims 1 to 3 and 5

The invention set forth in claims 1 to 3 and 5 is disclosed in documents 1 to 3 cited in the international search report, and therefore lacks novelty and does not involve an inventive step.

INTERNATIONAL PRESENTINARY EXAMINATION REPORT

Claim 4

The invention set forth in claim 4 does not involve an inventive step in the light of documents 1 to 4.

It would be easy for a person skilled in the art to apply the feature described in document 4, wherein the position in the film thickness direction at which the nitrogen concentration is the highest is localized within the central portion of the gate insulating film, to the gate insulating film set forth in documents 1 to 3.

Claims 6 to 8

The invention set forth in claims 6 to 8 is disclosed in document 3 (see paragraph [0102]) cited in the international search report, and therefore lacks novelty and does not involve an inventive step.

Moreover, the invention set forth in claim 8 does not involve an inventive step in the light of documents 1 to 3.

It would be easy for a person skilled in the art to apply the feature described in document 3, wherein a layer comprising a silicon oxide film is formed between a silicon substrate and a metal oxide film, which is a gate insulating film, to the gate insulating film set forth in documents 1 and 2.

Claim 9

The invention set forth in claim 9 does not involve an inventive step in the light of documents 1, 2, 3 and 5.

Documents 1 to 3 set forth a feature wherein nitrogen is introduced only to the upper part of a gate insulating film, in order to prevent boron penetration and to improve the interfacial characteristics of the gate insulating film.

Document 5 sets forth a gate insulating film comprising metal silicate, wherein the silicon

INTERNATIONAL PRESENTINARY EXAMINATION REPORT

concentration reaches a minimum at the central part of the gate insulating film.

It would therefore be easy for a person skilled in the art to apply the feature described in documents 1 to 3, wherein nitrogen is introduced only to the upper part of a gate insulating film, to the gate insulating film set forth in document 5.

Claims 10 and 14

The invention set forth in claims 10 and 14 does not involve an inventive step in the light of documents 3 and 6.

Document 6 sets forth a three-layer structure as a gate insulating film, comprising a silicon nitride film, a metal oxide film and a silicon nitride film.

Document 3 sets forth a feature wherein a layer comprising a silicon oxide film is formed between a substrate and a metal oxide film, which is a gate insulating film.

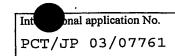
It would therefore be easy for a person skilled in the art to apply the silicon oxide film described in document 3 as an alternative to the silicon nitride film formed as the lowermost layer of the gate insulating electrode described in document 6.

Claims 11 and 12

The invention set forth in claims 11 and 12 is disclosed in documents 1 to 3 cited in the international search report, and therefore lacks novelty and does not involve an inventive step.

In addition, documents 5 and 6 indicate that the material set forth in claims 11 and 12 is used, therefore the invention set forth in claims 11 and 12 does not involve an inventive step in the light of documents 1, 2, 3, 5 and 6.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



Claims 13 and 15

The invention set forth in claims 13 and 15 is disclosed in document 3 cited in the international search report, and therefore lacks novelty and does not involve an inventive step.

Moreover, the invention set forth in claim 13 does not involve an inventive step in the light of documents 1, 2, 3 and 5.

It would be easy for a person skilled in the art to apply the feature described in document 3, wherein the introduction of nitrogen is carried out by irradiation with nitrogen-containing plasma, to the inventions set forth in documents 1, 2 and 5.

Claims 16 to 19

The invention set forth in claims 16 to 19 is not disclosed in any of the documents cited in the international search report, and would not be obvious to a person skilled in the art.

Claim 20

The invention set forth in claim 20 is disclosed in documents 1 to 3 cited in the international search report, and therefore lacks novelty and does not involve an inventive step.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

VI. Cer	tain documents cited						
1. Certa	ain published documents	s (Rule 70.10)					
	Application No. Patent No.	Publication (day/mont		Filing date (day/month/yea	r)	Priority date (valid claim (day/month/year)	m)
	JP 2002-299607 A	11 October 200	2 (11.10.2002)	28 March 2001 (2	8.03.2001)	,	
	[EX]						
					•		
2 Non	weitten disalassuss (Dul	I- 70 0)					
2. NOII-	written disclosures (Rul Kind of non-written			ritten disclosure nth/year)	referring t	of written disclosure to non-written disclosure day/month/year)	
			·		<u> </u>		

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

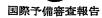
RECEIVED 2 2 JAN 2004

WIPO **PCT**

出願人又は代理人 の書類記号 NECO3PO32	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP03/07761	国際出願日(日.月.年)	19.06.03	優先日 (日.月.年)	27.06.02
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01L29/78, H01L21/336				
出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社				

国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01L29/78,H01L21/336				
出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社				
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。				
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で6 ページからなる。				
□ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。				
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。				
I X 国際予備審査報告の基礎				
II 優先権				
Ⅲ				
IV X 発明の単一性の欠如				
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため				
の文献及び説明 VI X ある種の引用文献				
VII 国際出願の不備				
VIII 国際出願に対する意見				
国際予備審査の請求書を受理した日 国際予備審査報告を作成した日				

国際予備審査の請求許を受理した日 19.06.03	国際予備審査報告を作成した日 22.12.03
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4M 9836
郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号	松帕 秀忠 印 1
	電話番号 03-3581-1101 内線 3460



国際出願番号 PCT/JP03/07761

Ι.	<u> </u>	国際予備審査報	発生の基礎 		
1.	局		に提出された差し替え用細		れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
	X	出願時の国際	路出願書類	• •	
		明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲		項、 項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		図面 図面 図面	第 第 第 	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	
		明細書の配列	刊表の部分 第 刊表の部分 第 刊表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2.	ل	上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場	合を除くほか、この	の国際出願の言語である。
	١	上記の書類は、	下記の言語である	語である	ర .
] []	PCT規	のために提出されたPC 則48.3(b)にいう国際公開 審査のために提出された	の言語	う翻訳文の言語 :は55.3にいう翻訳文の言語
3.	3	この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミ	: ノ酸配列を含んで:	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
]]]]	この国際 出願後に 出願後に 出願後に 書の提出	、この国際予備審査(ま 提出した書面による配列 があった る配列表に記載した配列	気ディスクによる配たは調査)機関に提たは調査)機関に提 たは調査)機関に提 をが出願時における	2列表 出された書面による配列表 出された磁気ディスクによる配列表 国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 る配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出
4.	 	前正により、↑ 明細書 請求の範囲	下記の書類が削除された。 第 第	ページ 項	
		図面	図面の第		ジ /図
5.		れるので、そ	お審査報告は、補充概に示 その補正がされなかったも ける判断の際に考慮しなけ	っのとして作成した。	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 告に添付する。)

国際予備審査報告	国際出願番号	PCT/JP03/07761
IV. 発明の単一性の欠如		
1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出	願人は、	
間では、「おおります」では、「ままります」では、「ままりままります」では、「ままります」では、「ままります」では、「ままります」では、「ままります」では、「ままります」では、「ままりますままります。」では、「ままりまります」では、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、「ままります。」は、これりまりままります。」は、「ままりままりまります。」は、「ままります。」は、ままりまります。」は、ままりまります。 これりまりまりまりまりまりまります。 これりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりま		
区 追加手数料を納付した。		
□ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。	•	
 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。		
2 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件でに従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人を	を満たしていない に求めないことと	、と判断したが、PCT規則68.1の規定 : した。
3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定	する発明の単一性	生を次のように判断する。
満足する。		
区 以下の理由により満足しない。		
請求の範囲の発明概念を形成のである。 一般の発明概念を形の質」のである。 一般の発明を選問がである。 一般をとシリケ事項「にいるである。 一般をとシリケ事項「にいるのである。」のである。 一般をとシリケ事項「にいるのである。」のである。 一般をしたがが、では、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは	関こい資記详支い、に明の7で9が資記のは、属置忍連記うで載の術る、ての国,い」導で載,い「シがめさ載事あか発的一、い数際1る、入あか1。7リ、るせさ項りら明特群、るに出5と「さりら4一,ケシ、るれで、しの徴の、、つ願」認6れ、し」方1ーリたての特で間は発、一きの、め」た特での、5トコといの特で間は発、一きの、め」た特での、5トコといるの、	かの一、会社のでは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学の

6-19]、[7, 15]、[9]、[20]、(2) [6]、(3) [10, 14] に区分される3個の発明が記載されていると認める。

4.	したかって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出	願の次の部分を、国際	予備審査の対象にした。
X	すべての部分	-	
	制求の範囲		に関する部分

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第12条	(PCT35条(2)) に定める見解	、それを裏付ける
1.	見解			
	新規性 (N)	請求の範囲 <u></u> 請求の範囲 _	4, 9, 10, 14, 16-19 1-3, 5-8, 11-13, 15, 20	
	進歩性(IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	16-19 · 1-15, 20	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-20	

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:H.-J.Cho et.al., Novel Nitrogen Profile Engineering for Improved TaN/H f02/Si MOSFET Performance, International Electron Devices Meeting. Technical Digest 2001

文献2:Hag-Ju Cho et.al., Structural and Electrical Properties of HfO₂ With T op Nitrogen Incorporated Layer, IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, VOL. 23, NO. 5, MAY 2002.

文献3:JP 2002-60944 A (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレー ション) 2002.02.28

文献4: JP 10-242461 A(ソニー株式会社) 1998.09.11

文献5:JP 2002-164343 A(アギア システムズ ガーディアン コーポレーション) 2002. 06. 07

文献6:US 6365467 B1(Hyundai Electronics Industries Co., Ltd.)2002.04.02

【請求の範囲1-3,5】

請求の範囲1-3,5に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3に記載され ているので、新規性、進歩性を有しない。 【請求の範囲4】

請求の範囲4に係る発明は、文献1乃至4により進歩性を有しない。

文献4により教示された窒素濃度が膜厚方向で最大となる位置をゲート絶縁膜の中 央部分に局在させる技術を、文献1乃至3のゲート絶縁膜に適用することは、当業者に とって容易である。

【請求の範囲6-8】

請求の範囲6-8に係る発明は、国際調査報告で引用された文献3(【0102】参照) に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。 また、請求の範囲8に係る発明は、文献1乃至3により進歩性を有しない。

文献3により教示されたゲート絶縁膜である金属酸化膜とシリコン基板との間にシ リコン酸化膜からなる層を形成する技術を、文献1万至2のゲート絶縁膜においても適 用することは、当業者にとって容易である。



国際予備審査幸	报告	国際出願番号 PC	CT/JP03/07761
I. ある種の引用文献			
. ある種の公表された文書 (PC	T規則70.10)	,	
出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主 (日.月.年)
JP 2002-299607. A	11. 10. 2002	28. 03. 2001	
			•
	:		
			,
			·
・ 書面による開示以外の開示 (P	· CT規則70.9)		·
・ 書面による開示以外の開示 (P 書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	: る開示以外の開示に言及して ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(2)		示の日付 書面によ	る開示以外の開示に言及して 書面の日付(日・月・年)
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開	示の日付 書面によ	
(2)	書面による開示以外の開		書面の日付(日.月.年)
(2)	書面による開示以外の開		書面の日付(日.月.年)



補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2. 欄の続き

【請求の範囲9】

請求の範囲9に係る発明は、文献1,2,3,5により進歩性を有しない。

文献1乃至3には、ゲート絶縁膜界面特性の向上及びボロンの突き抜けを防止するた めに、ゲート絶縁膜上部にのみ窒素を導入する技術が開示されている。

文献5には、金属シリケートからなるゲート絶縁膜において、シリコン濃度がゲー

ト絶縁膜中央部において最小となることが開示されている。

したがって、文献5に教示されたゲート絶縁膜において、文献1乃至3に教示された ゲート絶縁膜上部にのみ窒素を導入する技術を適用することは、当業者にとって容易 である。

【請求の範囲10,14】

請求の範囲10,14に係る発明は、文献3及び6により進歩性を有しない。

文献6には、ゲート絶縁膜として、シリコン酸窒化膜、金属酸化膜、シリコン酸窒 化膜からなる3層構造が開示されている。

文献3には、ゲート絶縁膜である金属酸化膜とシリコン基板との間にシリコン酸化

膜からなる層を形成する技術が開示されている。

したがって、文献6に教示されたゲート絶縁膜の最下層に形成されたシリコン酸窒 化膜にかえて文献3に教示されたシリコン酸化膜を適用することは、当業者にとって 容易である。

【請求の範囲11,12】

請求の範囲11,12に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3に記載され

ているので、新規性、進歩性を有しない。

また、文献5,6には請求の範囲11,12に記載された材料を用いていることが開示され ているので、請求の範囲11,12に係る発明は、文献1,2,3,5,6から進歩性を有しない。 【請求の範囲13,15】

請求の範囲13,15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献3に記載されている

ので、新規性、進歩性を有しない。 また、請求の範囲13に係る発明は、文献1,2,3,5により進歩性を有しない。 文献3に教示された窒素の導入を窒素含有プラズマ照射によって行う技術を、文献 1,2,5に教示された発明に適用することは、当業者にとって容易である。

【請求の範囲16-19】

請求の範囲16-19に係る発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載 されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

【請求の範囲20】

請求の範囲20に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3に記載されてい るので、新規性、進歩性を有しない。